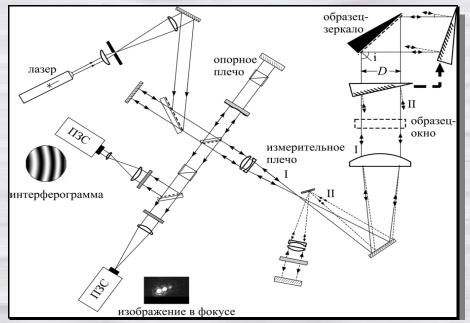


ООО «Электростекло» предлагает изготовление нового варианта

интерферометра Майкельсона типа MPEF (MultiPass Etalon Free interferometer), позволяющего контролировать с высокой точностью искажения волнового фронта при отражении от афокальных оптических компонентов или при прохождении через них.

Интерферометр MPEF регистрирует ошибку формы плоских поверхностей крупногабаритных оптических изделий (плоских зеркал, светоделителей, окон, подложек, клиньев и граней призм), а также искажения, вносимые в волновой фронт при прохождении через прозрачные плоские оптические компоненты (светоделители, окна, пластины, клинья) или через оптические телескопы. Прибор имеет высокую чувствительность измерений ошибки контролируемых элементов - от $\lambda/15$ до $\lambda/60$ (для лазерных длин волн 1064 нм, 633 нм или 532 нм по выбору заказчика, либо другая длина волны по согласованию). Чувствительность измерений зависит от количества проходов сканирующего пучка через контролируемый элемент (2, 4 или 8 проходов при соответствующей настройке прибора) и способа контроля - на отражение или пропускание (типа оптических компонентов), *подробнее, см. стр 2*. Максимальный диаметр контролируемых оптических изделий зависит от исполнения интерферометра MPEF (1, 2, 3) и составляет соответственно 100 мм, 200 мм и 300 мм, либо другой диаметр по согласованию. Способ измерения позволяет исключить использование традиционных плоских эталонов. Точность измерения ошибки не хуже ¼ соответствующей чувствительности, указанной в таблице: например, точность для зеркала ± $\lambda/250$, что позволяет контролировать зеркальные эталоны. Регистрация интерферограммы на ПЗС камеру с выводом на компьютер.

Прибор предназначен для использования в закрытых пылезащищенных помещениях с комнатной температурой и уровнем вибраций не более 3 g на виброчастотах более 5 Гц (резонансная частота виброподставки 2 Гц.) Предусмотрено обучение оператора заказчика правилам эксплуатации прибора.



	Без наклона	Наклон в горизонтальной плоскости	Наклон в вертикальной плоскости
Без образца			
С образцом (зеркало) Угол падения 15°, восемь отражений			

Интерферограмма зеркала λ/20 диаметром 200 мм (длина волны 1064 нм). Максимальная чувствительность измерения (8-проходовый режим).



eл: +/ (495) 234 59 51, 234-59-52, факс: +/ (910) 485 6/ 82 http://www.elektrosteklo.ru, sales@elektrosteklo.ru

Технические характеристики интерферометра МРЕГ:

Контрольная длина волны λ (рабочую длину волны выбирает заказчик) - 1064 нм, 633 нм или 532 нм, либо другая длина волны по согласованию.

Чувствительность к ошибке зеркала/светоделителя на отражение (коэффициент отражения R > 50%) от $\lambda/60$ Чувствительность к ошибке светоделителя/окна на пропускание (коэффициент пропускания T > 50%) от $\lambda/30$ Чувствительность к ошибке светоделителя на отражение (коэффициент отражения R > 20%) от $\lambda/30$ Чувствительность к ошибке светоделителя на пропускание (коэффициент пропускания T > 20% $\lambda/15$ Чувствительность к ошибке стеклянной подложки на отражение (коэффициент отражения $R \sim 4\%$, малый угол падения до 15°) $\lambda/15$

Предлагаем поставку интерферометра трех модификаций в соответствии с заданным диапазоном диаметров измеряемых деталей:

	Интерферометр MPEF-1	Интерферометр MPEF-2	Интерферометр MPEF-3
Диаметр контролируемых деталей	(50 ÷ 100) мм	(100 ÷ 200) мм	(150 ÷ 300) мм
Габариты установки (Ширина х Глубина х Высота)	1200 × 2000 x 1800 мм	1500 × 3000 х 1800 мм	1500 × 4000 x 1800 мм
Комплектация	Интерферометр на подставке, пылезащитный кожух, ноутбук, руководство по эксплуатации	Интерферометр на подставке, пылезащитный кожух, ноутбук, руководство по эксплуатации	Интерферометр на подставке, пылезащитный кожух, ноутбук, руководство по эксплуатации
Цена без НДС	по запросу	по запросу	по запросу
Срок поставки	6 месяцев	6 месяцев	6 месяцев